# 微聚焦菲涅尔波带板聚焦特性研究\*

董建军<sup>1);</sup> 曹磊峰<sup>1)</sup> 陈 铭<sup>1)</sup> 谢常青<sup>2</sup>) 杜华冰<sup>1)</sup>

1)(中国工程物理研究院激光聚变研究中心 绵阳 621900)
2)(中国科学院微电子研究所 北京 100029)
(2007年7月17日收到 2007年8月19日收到修改稿)

通过激光轰击 Ti 平面靶,用微聚焦菲涅尔波带板做成像器,测到了在放大倍数为 6.6 倍时 X 射线焦斑图像.利用 Fresnel-Kirchhoff 衍射积分公式数值模拟了微聚焦菲涅尔波带板的点扩展函数,模拟结果表明该微聚焦菲涅尔波带板在两倍焦距处强聚焦.改变物距和像距但保持透镜的物像距公式,也可得到类似的结果.模拟和实验表明微聚 焦波带板可以应用于 X 射线点对点成像,实现激光等离子体 X 射线高空间分辨成像.

关键词:菲涅尔波带板,Fresnel-Kirchhoff 衍射,数值模拟,点扩展函数 PACC:5270,0660J,7870D

### 1.引 言

在 ICF 激光等离子体诊断中 X 射线空间诊断 是很重要的一种诊断手段,传统的空间分辨元件一 直是针孔、狭缝,随着诊断精确性的要求,这种孔阑 元件的空间分辨已不能满足物理实验的需求 迫切 需要发展高空间分辨的成像元件,微聚焦菲涅尔波 带板是一种应用于 X 射线波段的高空间分辨成像 元件 其空间分辨率与波带板的最外环宽有关 理论 上波带板的瑞利分辨率为最外环宽的 1.22 倍11.波 带板能将 X 射线聚焦到几十个纳米<sup>[2]</sup>,是高空间分 辨 x 射线显微术<sup>[3]</sup>中的核心元件 目前国内波带板 的加工水平为最外环宽 100 nm 左右 高宽比可做到 8:1<sup>[4]</sup>.利用重叠纳米加工技术国外最好可做到最外 环为 15 nm 左右,其空间分辨率做到了 15 nm<sup>[5]</sup>,波 带板也应用于惯性约束聚变(ICF)空间诊断,一类应 用是将菲涅尔波带板用作编码元件<sup>[6—8]</sup>,对 X 射线 源成编码像然后通过一定的手段复原出源的图像; 另外一种应用就是直接利用菲涅尔波带板的聚焦特 性在 X 射线波段实现点到点成像<sup>[9]</sup>, ⅢE 的日本学 者利用位相波带板成功获得了激光等离子体密度轮 廓图像<sup>[10,11]</sup> 这表明微聚焦菲涅尔波带板可以像传统 意义上的透镜一样在 X 射线波段实现点物成点像.

#### 2. 微聚焦波带板点扩展函数数值模拟

波带板可以视为一种圆形光栅,因而也有多级 衍射现象,如图1所示.在平面单色波入射情况下且 波带板是理想的,各衍射级能量分配<sup>11</sup>为:直通占 25%,±1级各占10%,其他级占1%.表1是中科院 微电子所制作的544环,最外环宽为150 nm 微聚焦 菲涅尔波带的主要参数.我们利用 Fresnel-Kirchhoff 衍射积分公式(1)对此波带板的点扩展函数作了定 性模拟.在极坐标下对波带板平面进行离散化,并在 每个离散小区域利用泰勒展开取一级近似,可以对 该小区域Fresnel-Kirchhoff衍射积分公式(1)进行解



图 1 菲涅尔波带板多级衍射焦点示意图(其中 F 为一级焦距, -1 代表负一级衍射)

<sup>\*</sup>国家高技术研究发展计划(批准号 2006AA843070)资助的课题.

<sup>†</sup> E-mail :d \_ dragonfly@163.com

析求解.



图 2 模拟菲涅尔波带板点扩展函数光路示意图(R<sub>0</sub>代表点源 到波带板平面的距离,R1代表像面任意一点到波带板平面的距 离,U和V分别代表物距和像距,且满足1/U+1/V=1/F,波带 板平面采用极坐标表示)

如图 2 所示的光路 Fresnel-Kirchhoff 衍射积分 公式可表示为

$$E(x,y) = \frac{-i}{\lambda} \iint_{\Sigma} T(\xi,\eta) \frac{e^{iR_1} e^{iR_0}}{R_1 R_0} d\xi d\eta , \quad (1)$$
$$E(x,y) = \int_{\lambda_2}^{\lambda_1} P(\lambda) \left\{ \frac{-i}{\lambda} \iint_{\Sigma} T(\xi,\eta) \right\}$$
$$\times \frac{e^{iR_1} e^{iR_0}}{R_1 R_0} d\xi d\eta d\xi d\eta d\lambda , \quad (2)$$

其中(1)式中  $T(\xi,\eta)$ 为菲涅尔波带板的透过率,对

二值化波带板可以表示为

$$\mathcal{I}(\xi,\eta) = \begin{cases} 1, r_{2n-2} \leq \sqrt{\xi^{2} + \eta^{2}} \leq r_{2n-1} \\ n = 1, 2, \dots, \\ 0, \not \equiv 0 \end{cases}$$

其中 $r_n$ 表示波带板第n环半径( $\xi$ , $\eta$ )表示波带板 上一点坐标 (2) 式表示 点源具有  $P(\lambda)$  的谱分布 时的衍射振幅 这里没有考虑波带板材质对相位的 影响,且认为波带板无限薄,波带板参数设置取表1 中的数据模拟的结果如图 3 所示,从图 3(a)中可 以看出偶数级的衍射效率为零 且奇数级次越高 聚 焦情况越好,这与菲涅尔波带板理论符合[1],从而也 证明了我们的模拟方法是正确的.图 3(a)模拟的是 点源在光轴上的情况,为了考察点源处于不同视场 成像情况 模拟了点源在物面上处于 X 轴不同位置 时像面强度沿 X 轴的分布, 如图 4 所示. 从图 4 可以 清楚地看到 物面上一点对应像面上的一点 即我们 熟知的物象共轭点.例如物点(4.8,0, -U)在像面 的对应点的坐标大约在(-48.0,V),正好符合放大 倍数 M = 10 的条件,而且像点位置也正确,所以模 拟定性说明了波带板能够实现点到点成像,与可见 光中的透镜类似,但这种点到点成像只在小视场范 围内成立 我们知道可见光透镜成像 离轴越远的光 线几何像像差也越大,这说明波带板点到点成像也 只适合近轴光线

中科院微电子所制作的最外环宽 150 nm 菲涅尔波带板参数



图 3 (a) 点源通过菲涅尔波带板沿光轴的强度分布 (b) 点源在像平面横向分布(波带板第一级焦距 F = 177.8 mm(对 Ti的 特征线 4.7 keV) 模拟波带板环数 544 环 最外环宽 150 nm 物距和像距均为 2F)





图 4 点源在物面 X 轴不同位置时像面强度分布(物距 U = 195.4 mm ,放大倍数  $10 \times$  ,波带板第一级焦距 F = 177.8 mm(对 Ti 的特征线 4.7 keV) 图中竖排括号里的数字表示点源的坐标(坐标原点在波带板的中心))

3. 微聚焦波带板 X 射线成像实验

由于微聚焦波带板理论上的空间分辨率很高,

一般为波带板最外环的 1.22 倍,以表 1 中给出的数 据计算,这种波带板的空间分辨可以达到 0.2 µm 左 右,可以实现亚微米分辨,但实际应用中,尤其在激 光等离子体 X 射线诊断应用中,影响波带板空间分 辨的因素很多,诸如光源的单色性、物像距的精度, 波带板制作精度,吸收体的材料厚度以及波带板的 高宽比等等.为了考核应用在激光等离子体 X 射线 诊断的微聚焦波带板的聚焦性能,在激光打靶装置 上进行了波带板 X 射线成像实验.实验光路和成像 系统实物以及实验条件如图 5 所示.

从图 (ć a)中可以看出,虚线圈就是置于波带板 后的直径 2 mm 小孔所成的像,靠近虚线圈上部的亮 斑就是激光轰击 Ti 平面靶产生的 X 射线斑通过波 带板所成的图像,其半高宽可由图 (ć b)得出,虚线 圈所包围的阴影区域为直穿 X 射线所形成,其直径 反推到波带板面约为 2.2 mm,与放置于波带板后的 小孔光阑的直径相符.



图 5 激光能量 6 J 脉宽 1 ns 基频 1.06 µm ,10 µm 厚 Ti 平面靶 激光与靶面法线成 45°入射,前置 30 µm 厚的 Be 滤 片,紧贴波带板后放置厚度为 20 µm 钽片,中心开直径 2 mm 小孔,记录设备 2048 × 2048 X 射线 CCD,像素 13 µm.波 带板到靶的距离 215 mm 耙到 X 射线 CCD 灵敏面的距离大约 1625 mm,放大倍数 6.6× (a)激光打靶波带板成像 光路示意图 (b) 菲涅尔微聚焦波带板成像系统



图 6 (a)在激光打靶装置上获得的实验结果(b)横向扫描的 X 射线斑轮廓

#### 4.结 论

通过数值模拟波带板对点源的成像和 X 射线 成像实验的研究 表明菲涅尔微聚焦波带板在 X 射 线波段具有很好的聚焦性能 ,初步的实验证实了微 聚焦波带板在激光等离子体 X 射线成像诊断中可 实现点到点成像 ,可以作为 X 射线高空间分辨诊断 元件 ,通过提高波带板的质量 ,控制影响分辨的各类 不利因素 ,微聚焦波带板有望在激光等离子体 X 射 线亚微米空间分辨成像中获得广泛应用.

- [1] David A 1999 Soft X-ray and extrem ultraviolet radiation : Principle and Applications (Cambridge University Press ) chapter 334
- [2] Comamala J ,Borrise X ,Perez-Murano F ,Campos J ,Ferrer S 2006 Microelectronic Engineering 83 1355
- [3] Nieman B ,Rudolph D Schmahl G 1974 Opt. Commun. 12 160
- [4] Wnag D Q 2006 Doctor degree thesis(Institute of Microelectronics, Chinese Academy of Sciences ) chapter4 63(in Chinese ) 王德强 2006 博士学位论文(中科院微电子研究所)第四章第63页]
- [5] Chao W L , Harteneck B D , Alexander Liddle J , Anderson E H , Attwood D T 2005 Nature 435 1210
- [6] Gajendra Singh Solanki 2004 J. Opt. Soc. Am. A 21 517
- [7] Ten H , Yang X D , Feng J , Cheng J B , Cheng J X , Zheng Z J 2000

High power laser and Particle Beams 12 707 (in Chinese) [藤 浩、杨向东、冯 杰、陈家斌、成金秀、郑志坚 2000 强激 光与粒子束 12 707]

- [8] Ten H, Cao L F, Cheng J X, Chen J B, Yang X D, Liu Z L Zheng Z J 2002 Acta Phys. Sin. 51 835 (in Chinese)[藤 浩、曹磊峰、 成金秀、陈家斌、杨向东、刘忠礼、郑志坚 2002 物理学报 51 835]
- [9] Pfeiffer F ,David C 2006 Phy. Rev. B 73 245331-1
- [10] Hiroshi Azechi, Yohei Tamari, Hiroyuki Shiraga 2003 Institute of Laser Engineering Osaka University Annual Reports chapter 2 100
- [11] Yoshio Suzuki, Akihisa takeuchi, Hidekazu Takano, Hisataka Takenaka 2005 Japanese Journal of Applied Physics 44 1994

## Study on the focus performance of micro-focus Fresnel zone plate \*

Dong Jian-Jun<sup>1)†</sup> Cao Lei-Feng<sup>1</sup>) Chen Ming<sup>1</sup>) Xie Chang-Qing<sup>2</sup>) Du Hua-Bing<sup>1</sup>)

1 X Leaser Fusion Research Center , Chinese Academy of Engineering Physics , Mianyang 621900 , China )

2 X Institute of Microelectron , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100029 , China )

(Received 17 July 2007; revised manuscript received 19 August 2007)

#### Abstract

The performance of micro-focus Fresnel zone plate(MFZP) with the outermost width of 150 nm is tested using the Ti spectral line. Experimental data indicates that the image of pinhole with diameter of 12.5 µm fully responses to a pixel of the X-ray CCD camera. Furthermore the X-ray focal spot is tested with a magnification of 6.6 by using laser striking the Ti planar target. The MFZP 's point spread function is simulated with the integral formula of Fresnel-Kirchhoff diffraction. The simulated results indicate that the MFZP strongly focuses at double foci. The same results are obtained when the object distance and image distance change but keeping the relation of the lens unchanged. The simulation and the experiment indicate that MFZP can be applied to point-to-point imaging of X-ray to realize high spatial resolution imaging for the laser plasmas.

Keywords: Fresnel zone plate, Fresnel-Kirchhoff diffraction, numerical simulation, point spread function PACC: 5270,0660J,7870D

<sup>\*</sup> Project support by the National High Technology Development Program of China (Grant No. 2006AA843070).

<sup>†</sup> E-mail :d \_ dragonfly@163.com